PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-139835

(43) Date of publication of application: 26.05.1998

(51)Int.CI.

C08F279/02 C08F 4/76

(21)Application number: 08-300062

(71)Applicant:

UBE IND LTD

(22)Date of filing:

12.11.1996

(72)Inventor:

ASAKURA YOSHIO

WADA TAKASHI

TSUJIMOTO NOBUHIRO SUZUKI MICHINORI

(54) IMPACT-RESISTANT POLYSTYRENE-BASED RESIN

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polystyrene-based resin simultaneously improving reactivity with styrene monomer, impact resistance, low temperature characteristics, etc.

SOLUTION: This impact–resistant polystyrene–based resin contains 1–25wt.% of a rubbery polymer which is a high cis–high vinyl BR(butadiene rubber) comprising 65–95% of cis–1,4 structure and 30–4% of vinyl structure. A relation of the cis–1,4 structure to 1,2 structure in the rubbery polymer satisfies 1.0<β≤1.43 in the relation of β=P1,2–1,4/2 × P1,2 × P1,4 [P1,2 is content of 1,2 structure, P1,4 is content of 1,4 structure and P1,2–1,4 is content of a (1,2 structure) (1,4 structure) chain in whole diad chain].

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.06.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-139835

(43)公開日 平成10年(1998) 5月26日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

Publication date = May 26, 1998

C 0 8 F 279/02

4/76

C 0 8 F 279/02 4/76

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平8-300062

(71) 出願人 000000206

宇部興産株式会社

(22)出願日

平成8年(1996)11月12日

山口県宇部市西本町1丁目12番32号

(72)発明者 朝倉 好男

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興

産株式会社千葉石油化学工場内

(72)発明者 和田 隆

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興

産株式会社千葉石油化学工場内

(72)発明者 辻本 信弘

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興

産株式会社高分子研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 耐衝撃性ポリスチレン系樹脂

(57)【要約】

【課題】 スチレンモノマーとの反応性、耐衝撃性、低 温特性などを同時に改良することを目的とする。

【解決手段】 耐衝撃性スチレン系樹脂において、ゴム 状ポリマーが1~25重量%であり、ゴム状ポリマーの シス-1,4構造が65~95%であり、ビニル構造が 30~4%で構成された高シスー高ビニルBRで、ゴム 状ポリマーのシス-1,4構造と1,2構造の関係がβ $=P_{1,2-1,4}/2\times P_{1,2}\times P_{1,4}$ ($P_{1,2}$ は1, 2構 造含有率、P1.4 は1.4構造含有率を示し、P 1,2-1,4 は全ダイアッド連鎖中の(1,2構造)(1, 4構造)ダイアッド連鎖の含有率を示す〕なる関係式に おいて、1.0<β≤1.43を満足する範囲にあるこ とを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】ゴム状ポリマーを分散粒子として含有する ゴム変成した耐衝撃性ポリスチレン系樹脂において、

- (1) ゴム状ポリマーが1~25重量%であり、
- (2) ゴム状ポリマーのシス-1,4構造が65~95*

 $\beta = P_{1,2-1,4} / (2 \times P_{1,2} \times P_{1,4})$

〔式中、P_{1.2} は1, 2構造含有率を示し、P_{1.4} は 1, 4構造含有率を示し、P_{1,2-1,4} は全ダイアッド連 鎖中の(1, 2構造)(1, 4構造)ダイアッド連鎖の 含有率を示す。〕ことを特徴とする耐衝撃性ポリスチレ 10 利用した耐衝撃性ポリスチレン樹脂が報告されている ン系樹脂。

【請求項2】高シスー高ビニルボリブタジエンが、

- (a) 周期表第5族遷移金属化合物のメタロセン型錯体 及び、
- (b) 非配位性アニオンとカチオンとのイオン性化合物 及び/又はアルミノキサンからなる触媒系から得られる ことを特徴とする請求項1記載の耐衝撃性ポリスチレン 系樹脂。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、耐衝撃性能及び その他の性能がバランスよく改良されたゴム変成耐衝撃 性ポリスチレン系樹脂に関するものである。

[0002]

【従来の技術】スチレンモノマーにポリブタジエンを添 加してラジカル重合して得られる共重合体は、ポリスチ レンの持つ優れた特性に加えて耐衝撃も改良された耐衝 撃性ポリスチレン系樹脂として広く知られている。この 耐衝撃性ポリスチレン系樹脂を製造するために用いられ 媒として1,3-ブタジエンを重合して得られるシス-1, 4構造が30~35%、ビニル構造が10~20% であり、トランス-1,4構造が50~60%である低 シスポリブタジエン(以下、低シスBR)とコバルト、 チタン或いはニッケル系触媒により1,3-ブタジエン を重合して得られるシスー1、4構造が90~98%、 ビニル構造が1~5%であり、トランス-1,4構造が 1~5%である高シスポリブタジエン(以下、高シスB R)がある。一方、メチルアルミノキサン(以下、MA 〇) とチタン系メタロセン錯体、ブトキシチタネート化 40 【0005】 合物又は遷移金属のアセチルアセトン錯体を組合せた触 媒、即ちMAO-CpTiCl, (CpTi (OBu) 」, Ti (OBu)。)触媒系[Makromol. S утр. 89, 383 (1995)] や MAO-Ср VC1, (Cp, VC1) 触媒系 [Polymer, 3 <u>7</u>, 383 (1996)) 又はMAO-Cr (aca c), (V(acac), Fe(acac),) 触媒 系(IRC-95Kobe, Preprint, 25C ~4(1995)]を使用して高シス-高ビニルBR (以下、HC-HVBR)が得られたと報告されている 50

*%であり、1,2構造が30~4%で構成された高シス - 髙ピニルポリブタジエンであり、

(3) ゴム状ポリマーの1,4 構造と1,2 構造の関係 が下式(A)で表されるβ値が 1.0<β≤1.43 を満足する範囲にある

(A)

が、いずれも触媒活性が低く、ポリマー濃度も低い。 又、特公昭62-16201号公報にはコバルト系触媒 に二価アルコールを添加して得られたHC-HVBRを が、HC-HVBRの触媒活性が低くポリマー濃度も低 いので工業的ではない。更に特公昭56-50894号 公報及び特開昭55-129403号公報には有機リン 化合物を添加してもHC- HVBRが得られたと報告さ れているが、いずれも触媒活性が低く、ポリマー濃度も 低い。

【0003】高シスBRの特徴はガラス転移温度(通常 -95~-110°C) が低いため低温特性に優れるもの の、低ビニル構造含有量に起因するためにスチレンモノ マーとの反応性(グラフト率)が低く、高シスBRを用 いて得られる耐衝撃性ポリスチレン系樹脂は、アイゾッ ト衝撃性に優れるがゴム粒子の小粒径化(光沢性)・面 耐衝撃性(デュポン衝撃性)の点で十分満足できるもの ではない。他方、低シスBRはガラス転移温度(通常-75~-95℃)が高く、高ビニル構造含有量に起因す るためスチレンモノマーとの反応性(グラフト率)が高 く、低シスBRを用いて得られる耐衝撃性ポリスチレン 系樹脂はゴム粒子の小粒径化・面耐衝撃性が優れるもの の、アイゾット衝撃性・低温特性の点で十分満足できる るゴム変成剤としては、一般にはアルキルリチウムを触 30 ものではない。従って、BRを耐衝撃性ポリスチレン用 ゴムに使用する場合には、高シスBRの特性を保持し、 且つ低シスBRの特性を保持したBRの開発が強く望ま れている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、上記のス チレンモノマーとの反応性、耐衝撃性(アイゾット・デ ュポン)、低温特性及び光沢性などを同時に改良した耐 衝撃性ポリスチレン系樹脂を提供することを目的とす

【課題を解決のための手段】この発明によれば、ゴム状 ポリマーを分散粒子として含有するゴム変成した耐衝撃 性ポリスチレン系樹脂において、(1)ゴム状ポリマー が1~25重量%であり、(2)ゴム状ポリマーのシス -1,4構造が95~65%であり、ビニル構造が4~ 30%で構成された高シスー高ビニルポリブタジエンで あり、(3) ゴム状ポリマーの1,4 構造と1,2 構造 の関係が下式(A)で表される β 値が1.0< $\beta \le 1$. 43 を満足する範囲にある

 $\beta = P_{1,2-1,4} / (2 \times P_{1,2} \times P_{1,4})$ (A)

〔式中、P1.2 は1, 2 構造含有率を示し、P1.4 は 1, 4構造含有率を示し、P_{1,2-1,4} は全ダイアッド連 鎖中の(1,2構造)(1,4構造)ダイアッド連鎖の 含有率を示す。〕ことを特徴とする耐衝撃性ポリスチレ ン系樹脂が提供される。そして、高シスー高ビニルポリ ブタジエンが、(a)周期表第5族遷移金属化合物のメ タロセン型錯体、及び(b)非配位性アニオンとカチオ ンとのイオン性化合物及び/又はアルミノキサンからな る触媒系から得られる構成の耐衝撃性ポリスチレン系樹 10 脂が提供される。

【発明の実施の形態】

【0006】次にこの発明の構成成分について具体的に に説明する。(1)成分について説明する。(1)成分 は耐衝撃性ポリスチレン系樹脂におけるゴム状ポリマー でその含有率が1~25重量%である。ゴム状ポリマー の含有率が1重量%未満では、この発明の効果は得られ ないし、ゴム状ポリマーの含有率が増大すると共に樹脂 の耐衝撃性は向上するが、25重量%を越えると、スチ レン溶液の高粘度化によりゴム粒子径の制御が困難とな 20 は、この発明のHC-HVBR鎖中の1、2構造と1、 り、この発明の効果は発現できず工業的な利用価値を失 う。ゴム状ポリマーの含有率は、耐衝撃性、光沢性、耐 熱性、低温特性、硬度、流動性、引張特性などに影響す るので、必要最小限であることが好ましい。好ましくは 5~15%重量が好適である。通常の耐衝撃性ポリスチ レン系樹脂の製造法としては、ゴム状ポリマーの存在下 にスチレンモノマーの重合を行う方法が採用され、塊状 重合法や塊状懸濁重合法が経済的に有利な方法である。 製造時に必要に応じて上記ゴム状ポリマーの他に、スチ レンーブタジエン共重合体、エチレンープロピレン、エ 30 チレン-酢酸ビニル、アクリル系ゴムなどを上記ゴム状 ポリマーに対して50重量%以内併用することができ る。又、これらの方法によって製造された樹脂をブレン ドしてよい。更に、これらの方法によって製造されたゴ ム変成ポリスチレン系樹脂を含まないポリスチレン系樹 脂を混合して製造してもよい。上記の塊状重合法として 1例を挙げて説明すると、スチレンモノマー(99~7 5重量%) にゴム状ポリマー (1~25重量%) を溶解 させ、場合によっては溶剤、分子量調節剤、重合開始剤 などを添加して、10~40%のスチレンモノマー転化 40 発現することができる。 率までゴム状ポリマーを分散した粒子に転化させる。と のゴム粒子が生成するまではゴム相が連続相を形成して いる。更に重合を継続してゴム粒子として分散相になる 相の転換(粒子化工程)を経て50~99%の転化率ま で重合して耐衝撃性ポリスチレン系樹脂が製造される。 【0007】この発明で言うゴム状ポリマーの分散粒子 (ゴム粒子)は、樹脂中に分散された粒子で、ゴム状ポ

リマーとポリスチレン系樹脂よりなり、ポリスチレン系*

 $\beta = P_{1,i-1,i} / (2 \times P_{1,i} \times P_{1,i})$ (A)

式中の $P_{1,2}$ は1、2構造含有率を示し、 $P_{1,4}$ は1、50 4構造含有率を示し、 $P_{1,2-1,4}$ は全ダイアッド連鎖中

* 樹脂はゴム状ポリマーにグラフト結合したり、或いはグ ラフト結合せずに吸蔵されている。この発明で言うゴム 状ポリマーの分散粒子の径は0.5~7.0 µmの範囲 であり、好ましくは1.0~3.0μmの範囲である。 この範囲以外では、この発明の目的を達成できないので 好ましくない。

【0008】(2)成分について説明する。(2)成分 は、ゴム状ポリマーのシス-1、4構造が65~95% であり、ビニル構造が4~30%で構成された高シスー 高ビニルポリブタジエン(HC-HVBR)である。こ のような構成において、この発明の目的を達成すること が出来るので、このように構成されることが好ましい。 このようなゴム状ポリマーのHC-HVBRの分子量や 分岐度及びムーニー粘度(ML1+4)は特に限定するも のではないが、5%のスチレン溶液とした時の25℃で の粘度が20~400センチポイズ(c. p)、好まし くは30~200c.pの範囲のものが好ましい。 【0009】(3)成分について説明する。(3)成分 4構造の分布状態を表すパラメーターのβ値である。即 ち、1.0<β≤1.43。この発明のHC-HVBR のβ値は、上記式(A)で定義され、ポリブタジェン中 の1,2構造と1,4構造の分布を状態を示すパラメー ターである。即ち、 $\beta = 1$ の場合は1,2 構造と1,4 構造が完全にランダム状態で分布していることを表して いる。 $\beta > 1$ では1、2構造と1、4構造が交互に連な ってダイヤッド連鎖が、完全ランダム分布の場合より多 く存在していることを表している。逆に、β<1では 1,2構造と1,4構造がそれぞれブロック的に連なっ ているダイヤッド連鎖が、完全ランダム分布の場合より 多く存在していることを表している。この発明のHC-HVBRのβ値が1. 0<β≦1. 43、好ましくは 1. 0 < β ≤ 1. 25 を満足する範囲にあり、1, 2 構 造と1,4構造が交互に連なっているダイアッド連鎖の 割合が、完全ランダム分布の場合より多いことを特徴と するものである。それ故に、この発明のHC-HVBR は、従来知られていた耐衝撃性ポリスチレン系樹脂の製 造に適したポリブタジエンに対して更なる優れた効果を

【0010】 この発明で規定するHC-HVBRのβ値 は、Macromolecules, 20, 2418 (1987)記載の解析方法を参考にして、13C-NM Rスペクトルから1,2構造含有率、シス-1,4構造 含有率、トランス-1,4構造含有率、(1,2構造) (1,4構造)ダイアッド連鎖の含有率を求めて、下記 で定義されるP...、P... 及びP..... より算出さ れたものである。

の(1,2構造)(1,4構造)ダイアッド連鎖の含有 * 通りである。 率を示す。11C-NMRスペクトルの測定条件は以下の*

装置;日本電子製 EX-400型 FT-NMR

サンプル濃度;10%, o – ジクロルベンゼン/C。D。(4/1)溶媒

5 mm φチューブ使用

観測幅:2kHz 内部基準:TMS 測定温度:130℃

測定法:プロトンノイズデスカップリング

データポイント;32k 積算回数;5,000回

パルス繰り返し;3秒(45°)

【0011】次に(4)触媒成分について説明する。触 10%媒系である。 媒成分は、この発明のHC-HVBRの製造触媒であ る。即ち、(a)周期表第5族遷移金属化合物のメタロ

セン型錯体, 及び(b) 非配位性アニオンとカチオンと のイオン性化合物及び/又はアルミノキサンからなる触※

(1) RMX₃

(3) RM (O) X_2

などの一般式で示される化合物が挙げられる。上記式で Rはシクロペンタジェニル基及びその置換シクロペンタ ジエニル基、インデニル基及びその置換インデニル基、 シリルシクロペンタジエニル基又はフルオレニル基であ 20 ピルエーテル、ベンジルエーテル、テトラヒドロフラ る。aは0、1又は2である。nは1又は2である。M は周期表第5族遷移金属化合物を示す。具体的にはバナ ジウム(V), ニオブ(Nb), タンタル(Ta)であ り、好ましくはパナジウムである。Xは水素、ハロゲン (フッ素、塩素、臭素、沃素が挙げられる)、炭素数1 ~20の炭化水素基(メチル、エチル、n-プロピル、is o-プロピル、n-ブチル、iso-ブチル、sec-ブチル、tert - ブチル、n-ヘキシルなどの直鎖状炭化水素基又は分岐 状炭化水素基、フェニル、トリル、ナフチル、ベンジル などの芳香族炭化水素基、更にトリメチルシリルなどの 30 ンタジエニルバナジウムトリクロライド、エチルシクロ ケイ素原子を含有する炭化水素基なども含む)、アルコ キシル基(メトキシル基、エトキシル基、フェノキシル 基、プロポキシル基、ブトキシル基、アミルオキシル 基、ヘキシルオキシル基、オクチルオキシル基、2-エチ ルヘキシルオキシル基、チオメトキシル基など)又はア ミノ基(ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジイソ プロビルアミノ基など)を示す。上記の中でもXとして は、フッ素・塩素・臭素原子、メチル基、エチル基、ブ チル基、メトキシル基、エトキシル基、ジメチルアミノ 基、ジエチルアミノ基などが好ましい。Lは、対電子を 40 シクロペンタジエニルバナジウムトリクロライド、(ジ 有し、金属に配位できるルイス塩基性の一般的な無機・ 有機化合物であるルイス塩基である。その中でも活性水 素を有しない化合物が特に好ましく、具体的にはピリジ ン、トリエチルアミン、トリブツルアミン、又はジメチ ルアニリンなどの第3アミン、メタノール、エタノール などのアルコール、トリメチルフォスフィン、トリエチ ルフォスフィン、トリプチルフォスフィン、又はトリフ ェニルフォスフィンなどの第3フォスフィン、アセト ン、メチルエチルケトン、アセチルアセトンなどのケト

【0012】この発明の触媒成分を更に具体的に説明す る。(a) 周期表第5族遷移金属化合物のメタロセン型 錯体としては、

6

- (2) $R_n MX_{3-n} \cdot L_a$
- (4) $R_n MX_{3-n} (NR')$

ルアセトアミド、N. N-ジエチルフォルムアミド、 N, N-ジエチルアセトアミドなどのN, N-ジアルキ ルアミド、エチルエーテル、ブチルエーテル、イソプロ ン、ポリエチレングリコールジメチルエーテル類、アニ ゾール、フェネトールなどのエーテルなどが挙げられ る。エステル化合物、シリルオキシル化合物も含まれ

【0013】一般式(1) RMX, で示される具体的化合 物としては、以下の通りである。

(イ) シクロペンタジエニルバナジウムトリクロライド が挙げられる。そのモノ置換シクロペンタジエニルバナ ジウムトリクロライドとしては、例えばメチルシクロペ ベンタジェニルバナジウムトリクロライド、プロピルシ クロベンタジエニルバナジウムトリクロライド、イソプ ロピルシクロペンタジエニルバナジウムトリクロライ ド、tert- ブチルシクロペンタジエニルバナジウムトリ クロライド、(1,1- ジメチルプロピル) シクロペンタジ エニルバナジウムトリクロライド、(1,1- ジメチルベン ジル)シクロペンタジエニルバナジウムトリクロライ ド、(1- エチルプロピル) シクロペンタジエニルバナジ ウムトリクロライド、(1-エチル,1-メチルプロピル) エチルベンジル) シクロペンタジエニルバナジウムトリ クロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル) バナジウムトリクロライド、〔ビス(トリメチルシ リル) シクロペンタジエニル〕 バナジウムトリクロライ ドなどが挙げられる。

【0014】ジ置換シクロペンタジエニルバナジウムト リクロライドとしては、例えば(1,3-ジメチルシクロペ ンタジエニル) バナジウムトリクロライド、(1- メチル -3-エチルシクロペンタジエニル) バナジウムトリクロ ン、N, N-ジメチルフォルムアミド、N, N-ジメチ 50 ライド、(1- メチル-3- プロピルシクロペンタジエニ

ル) バナジウムトリクロライド、〔 1- メチル-3- ビス (トリメチルシリル)シクロペンタジエニル]バナジウ ムトリクロライド、 1-メチル-3- ビス(トリメチルシ リルシクロペンタジエニル) バナジウムトリクロライ ド、(1- メチル-3- フェニルシクロペンタジエニル) バ ナジウムトリクロライド、(1- メチル-3- トリルシクロ ペンタジエニル) バナジウムトリクロライド、〔1- メ チル-3-(2,6-ジメチルフェニル) シクロペンタジエニ ル] バナジウムトリクロライド、(1- メチル-3- ブチル シクロペンタジエニル) バナジウムトリクロライドなど 10 シクロペンタジエニル)(ビスジエチルアミド) バナジウ が挙げられる。

【0015】トリ置換シクロペンタジエニルバナジウム トリクロライドとしては例えば(1,2,3- トリメチルシク ロペンタジエニル) バナジウムトリクロライド、(1,2,4 - トリメチルシクロペンタジエニル) バナジウムトリク ロライドなどが挙げられる。テトラ置換シクロペンタジ エニルバナジウムトリクロライドとしては、例えば(1, 2,3,4- テトラメチルシクロペンタジエニル) バナジウ ムトリクロライド、(1,2,3、4-テトラフェニルシクロペ ンタジエニル) バナジウムトリクロライドなどが挙げら 20 て、これらの塩素原子をメチル基で置換したメチル体で れる。ペンタ置換シクロペンタジエニルバナジウムトリ クロライドとしては、例えば(ペンタメチルシクロペン タジエニル) バナジウムトリクロライド、(1,2,3,4-テ トラメチル-5- フェニルシクロペンタジエニル) バナジ ウムトリクロライド、(1,2,3,4- テトラフェニル-5- メ チルシクロペンタジエニル) バナジウムトリクロライド などが挙げられる。

【0016】(ロ)インデニルバナジウムトリクロライ ドが挙げられる。その置換インデニルバナジウムトリク ロライドとしては、例えば (2-メチルインデニル) バナ ジウムトリクロライド、(2-トリメチルインデニル)バ ナジウムトリクロライドなどが挙げられる。

【0017】(ハ)上記の(イ)~(ロ)の化合物の塩 素原子をアルコキシ基、メチル基で置換したモノアルコ キシド、ジアルコキシド、トリアルコキシドなどが挙げ られる。例えばトリメチルシリルシクロペンタジエニル バナジウムトリ tert-ブトキサイド、トリメチルシクロ ペンタジエニルバナジウムトリ iso- プロポキサイド、 トリメチルシリルシクロペンタジエニルバナジウムジメ ニルバナジウムジtert- ブトキシクロライド、トリメチ ルシリルシクロペンタジエニルバナジウムジフェノキシ クロライド、トリメチルシリルシクロペンタジエニルバ ナジウムジ iso- プロキシクロライド、トリメチルシリ ルシクロペンタジエニルバナジウム tert-ブトキシジク ロライド、トリメチルシリルシクロペンタジエニルバナ ジウムフェノキシジクロライドなどである。そして、と れらの塩素原子をメチル基で置換したジメチル体であ る。そして、更にこのジメチル体の塩素原子をアルコキ シ基で置換したモノアルコキシ体、ジアルコキシ体であ 50 クロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ

る。モノクロル体をメチル基で置換した化合物が挙げら れる。

【0018】(ニ)上記の(イ)~(ロ)の化合物の塩 素原子をアミド基で置換したアミド体が挙げられる。例 えば(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(トリス ジエチルアミド) バナジウム、(トリメチルシクロペン タジエニル) (トリスiso-プロピルアミド) バナジウ ム、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(トリス n- オクチルアミド) バナジウム、(トリメチルシリル ムクロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル) (ビス iso- プロピルアミド) バナジウムクロライ ド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(ビスn-オクチルアミド) バナジウムクロライド、(トリメチル シリルシクロペンタジエニル)(ジエチルアミド) バナジ ウムジクロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジ エニル)(iso-プロピルアミド) バナジウムジクロライ ド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(n-オク チルアミド) バナジウムジクロライドなどである。そし ある。

【0019】 Rが炭化水素基、シリル基によって結合さ れたものが挙げられる。例えば(tert-ブチル)ジメチ ルシリル(η'-シクロペンタジエニル)バナジウムジク ロライド、(tert- ブチルアミド) ジメチルシリル(ト リメチル- η'-シクロペンタジエニル) バナジウムジク ロライド、 (tert- ブチルアミド) ジメチルシリル(テ トラメチル- η¹-シクロペンタジエニル) バナジウムジ クロライドなどである。そして、これらの塩素原子をメ 30 チル基で置換したジメチル体である。そして、更にこの ジメチル体の塩素原子をアルコキシ基で置換したモノア ルコキシ体、ジアルコキシ体である。モノクロル体をメ チル基で置換した化合物が挙げられる。

【0020】(イ)~(二)の塩素原子をアミド基で置 換したアミド体が挙げられる。例えば、(トリメチルシ リルシクロペンタジエニル)(トリスジエチルアミド)バ ナジウム、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (トリスiso-プロピルアミド)バナジウム、(トリメチル シリルシクロペンタジエニル)(トリスn-プロピルアミ トキシクロライド、トリメチルシリルシクロペンタジエ 40 ド) バナジウム、(トリメチルシリルシクロペンタジエ ニル)(トリスn-オクチルアミド) バナジウム、(トリメ チルシリルシクロペンタジエニル)(ピスジエチルアミ ド) バナジウムクロライド、(トリメチルシリルシクロ ペンタジエニル)(ビスiso-プロピルアミド) バナジウム クロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル)(ピスn-オクチルアミド) バナジウムクロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(ジチルアミ ド) バナジウムジクロライド、(トリメチルシリルシク ロペンタジエニル)(iso-プロピルアミド) バナジウムジ

ル)(n-オクチルアミド) バナジウムジクロライドなどが 挙げられる。これらの塩素原子をメチル基で置換したメ チル体が挙げられる。

【0021】一般式(2) R。MX,-。・L。の中で、R MX、で表せる具体的な化合物としては、、シクロペン タジエニルバナジウムジクロライド、メチルシクロペン タジエニルバナジウムジクロライド、(1,3-ジメチ ルシクロペンタジエニル) バナジウムジクロライド、 (1-メチル-3-ブチルシクロペンタジエニル)バナ ジウムジクロライド、(ペンタメチルシクロペンタジエ 10 ニル) バナジウムジクロライド、(トリメチルシリルシ クロペンタジエニル) バナジウムジクロライド、〔1, 3-ジ(トリメチルシリル)シクロペンタジエニル]バ ナジウムジクロライド、インデニルバナジウムジクロラ イド、(2-メチルインデニル)バナジウムジクロライ ド、(2-メチルシリルインデニル)バナジウムジクロ ライド、フルオレニルバナジウムジクロライドなどのジ クロライド体が挙げられる。上記の各化合物の塩素原子 をメチル基で置換したジメチル体も挙げられる。

合されたものも含まれる。例えば、(t‐ブチルアミ ド) ジメチルシリル (η⁵ -シクロペンタジエニル) バ ナジウムクロライド、(t-ブチルアミド)ジメチルシ リル (テトラメチルーη' -シクロペンタジエニル) バ ナジウムクロライドなどのアミドクロライド体、或いは これらの化合物の塩素原子をメチル基で置換したアミド 体などが挙げられる。シクロペンタジエニルバナジウム ジメトキサイド、シクロペンタジエニルバナジウムジi so-プロポキサイド、シクロペンタジエニルバナジウ ムジ tert-ブトキサイド、シクロペンタジエニルオ 30 ル) シランバナジウムクロライドなどのクロライド体、 キソバナジウムジフェノキサイド、シクロペンタジエニ ルバナジウムメトキシクロライド、シクロペンタジエニ ルバナジウムisoープロポキシクロライド、シクロペ ンタジエニルバナジウムtert-プトキシクロライ ド、シクロペンタジエニルバナジウムフェノキシクロラ イドなどのアルコキシド体が挙げられる。これらの化合 物の塩素原子をメチル基で置換したジメチル体も挙げら れる。(シクロペンタジエニル)(ビスジエチルアミ ド) バナジウム、(シクロペンタジエニル) (ビスジi so-プロピルアミド) バナジウム、(シクロペンタジ 40 ニル) オキソバナジウムジクロライド、(トリメチルシ エニル) (ビスジn-オクチルアミド) バナジウムなど のビスアミド体が挙げられる。

【0023】一般式(2) R。MX, · · L。の中でRM X2. · L2 で表せる具体的な化合物としては、シクロペ ンタジエニルバナジウムジクロライド・ピストリメチル フォスフィン錯体、シクロベンタジエニルバナジウムジ クロライド・ビストリエチルフォスフィン錯体、(クロ ペンタジエニル)(ビスジiso-プロピルアミド)ト リメチルフォスフィン錯体、モノメチルシクロペンタジ

フィン錯体などのフォスフィン錯体があげられる。 【0024】一般式(2) R_n MX_{3-n} · L_n の中でR₂ MX1・L2で表せる具体的な化合物としては、ジシク ロペンタジエニルバナジウムクロライド、ビス(メチル シクロペンタジエニル) バナジウムクロライド、ビス (1, 3-ジメチルシクロペンタジエニル) バナジウム クロライド、ビス(1-メチル-3-ブチルシクロペン タジエニル) バナジウムクロライド、ビス (ペンタメチ ルシクロペンタジエニル) バナジウムクロライド、ビス (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) バナジウム クロライド、ビス〔1,3-ジ(トリメチルシリル)シ クロペンタジエニル] バナジウムクロライド、ジインデ ニルバナウムジクロライド、ビス(2-メチルインデニ ル) バナジウムクロライド、ビス(2-メチルシリルイ ンデニル) バナジウムクロライド、ジフルオレニルバナ ジウムクロライドなどのクロライド体が挙げられる。上 記の各化合物の塩素原子をメチル基で置換したメチル体 も挙げられる。シクロペンタジエニルバナジウムメトキ サイド、ジシクロペンタジエニルバナジウムiso-プ 【0022】RとXが炭化水素基、シリル基によって結 20 ロボキサイド、ジシクロベンタジエニルバナジウムte rtーブトキサイド、ジシクロペンタジエニルバナジウ ムフェノキサイド、ジシクロペンタジエニルジエチルア ミドバナジウム、ジシクロペンタジエニルジiso-プ ロピルアミドバナジウム、ジシクロペンタジエニルジn - オクチルアミドバナジウムなどが挙げられる。

> 【0025】Rが炭化水素基、シリル基によって結合さ れたものも含まれる。例えば、ジメチルビス(カ・ーシ クロベンタジエニル) シランバナジウムクロライド、ジ メチルビス (テトラメチル-η' -シクロペンタジエニ 或いはこれらの化合物の塩素原子をメチル基で置換した メチル体などが挙げられる。

> 【0026】一般式(3) RM(O)X, で表せる具体的 な化合物としては、シクロペンタジエニルオキソバナジ ウムジクロライド、メチルシクロベンタジエニルオキソ バナジウムジクロライド、(1,3-ジメチルシクロペ ンタジエニル)オキソパナジウムジクロライド、(1-メチルー3-プチルシクロペンタジエニル)オキソバナ ジウムジクロライド、(ペンタメチルシクロペンタジエ リルシクロペンタジエニル) オキソバナジウムジクロラ イド、(1,3-ジ(トリメチルシリル)シクロペンタ ジエニル] オキソバナジウムジクロライド、インデニル オキソバナジウムジクロライド、(2-メチルインデニ ル)オキソバナジウムジクロライド、(2-メチルシリ ルインデニル) オキソバナジウムジクロライド、フルオ レニルオキソバナジウムジクロライドなどが挙げられ る。上記の各化合物の塩素原子をメチル基で置換したジ メチル体も挙げられる。

エニルバナジウムジクロライド・ピストリエチルフォス 50 【0027】RとXが炭化水素基、シリル基によって結

合されたものも含まれる。例えば、(t-ブチルアミ ド) ジメチルシリル (η' -シクロペンタジエニル) オ キソバナジウムクロライド、(t-ブチルアミド)ジメ チルシリル (テトラメチルー n' -シクロペンタジエニ ル) オキソバナジウムクロライドなどのアミドクロライ ド体、或いはこれらの化合物の塩素原子をメチル基で置 換したアミド体などが挙げられる。シクロペンタジエニ ルオキソバナジウムジメトキサイド、シクロペンタジエ ニルオキソバナジウムジ i s o - プロポキサイド、シク ロベンタジエニルオキソバナジウムジtert-ブトキ 10 ドクロライド体、或いはこれらの化合物の塩素原子をメ サイド、シクロペンタジエニルオキソバナジウムジフェ ノキサイド、シクロペンタジエニルオキソバナジウムメ トキシクロライド、シクロペンタジエニルオキソバナジ ウムisoープロポキシクロライド、シクロペンタジエ ニルオキソバナジウムtertープトキシクロライド、 シクロペンタジエニルオキソバナジウムフェノキシクロ ライドなどが挙げられる。これらの化合物の塩素原子を メチル基で置換したジメチル体も挙げられる。(シクロ ペンタジエニル) (ビスジエチルアミド) オキソバナジ ウム、(シクロペンタジエニル) (ビスジiso-プロ 20 ピルアミド) オキソバナジウム、(シクロペンタジエニ ル) (ビスジn-オクチルアミド) オキソバナジウムな ども挙げられる。

11

【0028】(4) R。MX3-。(NR')で表せる具体 的な化合物としては、シクロペンタジエニル(メチルイ ミド) パナジウムジクロライド、シクロペンタジエニル (フェニルイミド) バナジウムジクロライド、シクロペ ンタジエニル(2,6-ジメチルフェニルイミド)バナ ジウムジクロライド、シクロペンタジエニル(2,6-ジiso-プロピルフェニルイミド) パナジウムジクロ ライド、(メチルシクロペンタジエニル)(フェニルイ ミド) バナジウムジクロライド、 (メチルペンタメチル シクロペンタジエニル) バナジウムジクロライド、

〔1,3-ジメチルシクロベンタジエニル(フェニルイ ミド)]バナジウムジクロライド、(1-メチル-3-ブチルシクロペンタジエニル) (フェニルイミド) バナ ジウムジクロライド、(ペンタメチルシクロペンタジエ ニル) (フェニルイミド) パナジウムジクロライド、イ ンデニル (フェニルイミド) パナジウムジクロライド、 クロライド、フルオレニル (フェニルイミド) バナジウ ムジクロライドなどのジクロライドが挙げられる。

【0029】RとXが炭化水素基、シリル基によって結 合されたものも含まれる。例えば、(t‐ブチルアミ ド) ジメチルシリル (η¹ -シクロペンタジエニル) (フェニルイミド) バナジウムクロライド、(t −ブチ ルアミド) ジメチルシリル (テトラメチルーη'ーシク ロペンタジエニル) (フェニルイミド) バナジウムクロ ライドなどのアミドクロライド体、或いはこれらの化合

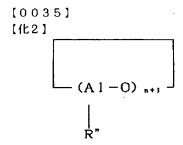
られる。Rが炭化水素基、シリル基によって結合された ものも含まれる。例えば、ジメチルピス(η '-シクロ ペンタジエニル) シラン (フェニルイミド) バナジウム クロライド、ジメチルビス (η¹ -シクロペンタジエニ ル)シラン(トリルイミド)バナジウムクロライド、ジ メチル (テトラメチル - η ' - シクロペンタジエニル) シラン (フェニルイミド) バナジウムクロライド、ジメ チル (テトラメチルーη' -シクロペンタジエニル) シ ラン(トリルイミド)パナジウムクロライドなどのアミ チル基で置換したアミド体などが挙げられる。シクロペ ンタジエニルバナジウム (フェニルイミド) ジメトキサ イド、シクロペンタジエニルオキソバナジウム(フェニ ルイミド)ジiso-プロポキサイド、シクロペンタジ エニルバナジウム (フェニルイミド) (iso-プロボ キシ)クロライド、(シクロペンタジエニル)(ビスジ エチルアミド) バナジウム (フェニルイミド)、(シク ロペンタジエニル) (ビスiso-ブロビルアミド) バ ナジウム (フェニルイミド) などが挙げられる。

【0030】この発明の(b)成分のうち、非配位性ア ニオンとカチオンとのイオン性化合物を構成する非配位 性アニオンとしては、例えば、テトラ (フェニル) ボレ ート、テトラ (フルオロフェニル) ボレート、テトラキ ス (ジフルオロフェニル) ボレート、テトラキス (トリ フルオロフェニル) ボレート、テトラキス (テトラフル オロフェニル) ボレート、テトラキス (ペンタフルオロ フェニル) ボレート、テトラキス (テトラメチルフルオ ロフェニル) ボレート、テトラ (トリイル) ボレート、 テトラ (キシリル) ボレート、テトラ (キシリル) ボレ 30 ート、(トリフェニル、ペンタフルオロフェニル)ボレ ート、〔トリス(ペンタフルオロフェニル)フェニル〕 ボレート、トリデカハイドライド-7,8-ジカルバウ ンデカボレート、テトラフルオロボレートなどが挙げら

【0031】一方、カチオンとしては、カルボニウムカ チオン、オキソニウムカチオン、アンモニウムカチオ ン、ホスフォニウムカチオン、シクロヘプチルトリエニ ルカチオン、遷移金属を有するフェロセニウムカチオン などを挙げることができる。カルボニウムカチオンの具 2-メチルインデニル(フェニルイミド)バナジウムジ 40 体例としては、トリフェニルカルボニウムカチオン、ト リ置換フェニルカルボニウムカチオンなどの三置換カル ボニウムカチオンを挙げることができる。トリ置換フェ ニルカルボニウムカチオンの具体例としては、トリ(メ チルフェニル) カルボニウムカチオン、トリ (ジメチル フェニル) カルボニウムカチオンなどを挙げることがで きる。アンモニウムカチオンの具体例としては、トリメ チルアンモニウムカチオン、トリエチルアンモニウムカ チオン、トリプロピルアンモニウムカチオン、トリブチ ルアンモニウムカチオンなどのトリアルキルアンモニウ 物の塩素原子をメチル基で置換したアミド体などが挙げ、50 ムカチオン、N、N-2、4、6-ベンタメチルアンモ ニウムカチオン、ジ (iso-プロピル) アンモニウム カチオン、ジシクロヘキシルアンモニウムカチオンなど のジアルキルアンモニウムカチオンなどを挙げることが できる。ホスフォニウムカチオンの具体例としては、ト リフェニルフォスフォニウムカチオン、トリ(メチルフ ェニル) フォスフォニウムカチオン、トリ(ジメチルフ ェニル) フォスフォニウムカチオンなどのトリアリール フォスフォニウムカチオンなどを挙げることができる。 【0032】そして、イオン性化合物としては、前記の 組み合わせたものを、好ましく用いることができる。な かでもイオン性化合物としては、トリチルテトラ(ベン タフルオロフェニル) ボレート、トリフェニルカルボニ ウムテトラ (フルオロフェニル) ボレート、N, N-ジ メチルアニリニウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) ボレート、1, 1'ージメチルフェロセニウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) ボレートなどが好ましい。 イオン性化合物を単独で用いてもよく、2種以上を組合 せて使用してもよい。

【0033】との発明の(b)成分としてアルミノキサ 20 グネシウムクロライド、ブチルマグネシウムクロライ ンを使用してもよい。アルミノキサンとしては、一般式 (化1、化2)が直鎖状のものや環状のものが挙げられ る(R"は炭素数1~10の炭化水素基であり、一部を ハロゲン原子及び又はアリコキシル基で置換されたも の、nは重合度であり2以上の整数を示す)。特にR" はメチルであるメチルアルミノキサンでnが5以上、好 ましくは10以上のものが利用される。上記のアルミノ キサン類には若干のアルキルアルミニウム化合物が混入 していても差し支えない。

[0034] 【化1】 $R' - (A1 - O) - A1R'_{2}$



【0036】との発明において(a)成分及び(b)成 分に、更に(c)成分として周期表第1~3族元素の有 機金属化合物を組合せた触媒系を使用してもよい。

(c) 成分の添加により重合活性が向上する。周期表第 1~3族元素の有機金属化合物としては、有機アルミニ 50 分、次いでメタロセン型錯体を添加する。

ウム化合物、有機リチウム化合物、有機マグネシウム化 合物、有機亜鉛化合物、有機ホウ素合物などが挙げられ る。又、これらの有機金属ハロゲン化合物、水素化有機 金属化合物も含まれる。また有機金属化合物を2種以上 併用することができる。(c)成分の具体的な化合物と しては、トリメチルアルミニウム、ジメチルアルミニウ ムクロライド、トリエチルアルミニウム、セスキエチル アルミニウムクロライド、ジエチルアルミニウムクロラ イド、セスキエチルアルミニウムハイドライド、ジエチ 非配位性アニオン及びカチオンの中から任意に選択して 10 ルアルミニウムハイドライド、トリイソブチルアルミニ ウム、トリヘキシルアルミニウム、トリオクチルアルミ ニウム、トリデシルアルミニウム、メチルリチウム、ブ チルリチウム、フェニルリチウム、ベンジルリチウム、 ネオペンチルリチウム、トリメチルシリルメチルリチウ ム、ビストリメチルシリルメチルリチウム、ジブチルマ グネシウム、ブチルマグネシウムクロライド、ジヘキシ ルマグネシウム、エチルマグネシウムクロライド、ジエ チル亜鉛、ジメチル亜鉛、トリフッ化ホウ素、トリフェ ニルホウ素などを挙げることができる。更に、エチルマ ド、ジメチルアルミニウムクロライド、ジエチルアルミ ニウムクロライド、セスキエチルアルミニウムクロライ ド、エチルアルミニウムシクロライドなどのような有機 金属ハロゲン化合物、ジエチルアルミニウムハイドライ ド、セスキエチルアルミニウムハイドライドなどのよう な水素化有機金属化合物素などを挙げることができる。 有機金属化合物は2種類以上併用することができる。ま た、(b)成分としてイオン性化合物を用いる場合に は、(c)成分として前記のアルミノキサンを組合せて 30 使用してもよい。

> 【0037】各触媒成分の配合割合は、各種条件により 異なるが、(a)成分のメタロセン錯体と(b)成分の アルミノキサンとのモル比は、好ましくは1:1~1: 10,000、より好ましくは1:1~1:5,000 である。(a)成分のメタロセン型錯体と(b)成分の イオン性化合物とのモル比は、好ましくは1:0.1~ 1:10、より好ましくは1:0.2~1:5である。 (a) 成分のメタロセン型錯体と(c) 成分の有機金属 化合物とのモル比は、好ましくは1:0.1~1:1, 40 000、より好ましくは1:0.2~1:500であ

【0038】触媒成分の添加順序は、特に制限はない が、例えば次の順序で行うことができる;

②重合モノマーと(b)成分との接触混合物にメタロセ ン型錯体を添加する。

②重合モノマーと(b)成分及び(c)成分を任意の順 序で添加した接触混合物にメタロセン型錯体を添加す

③重合モノマーと(c)成分の接触混合物に(b)成

④重合モノマーにメタロセン型錯体と(b)成分を任意 の順序で接触させた混合物を添加する。

尚、HC-HVBRの分子量調節剤としては、水素を使 用するのが経済的であり、重合方法としては、特に制限 はなく、塊状重合や溶液重合などを適宜目的に合わせて 行えばよい。溶媒として脂肪族炭化水素、芳香族炭化水 素やこれらのハロゲン化炭化水素を適宜目的に合わせて 行えばよく、2種以上組合せて用いてもよい。

【0039】上記の方法によって得られたHC-HVB Rとスチレン系モノマーによる耐衝撃性ポリスチレン系 10 樹脂の製造方法について説明する。この発明の目的にか なうものであればバッチ式でも連続的製造方法でもよく 特に限定されない。スチレン系モノマーとしては、例え ぱスチレン、αーメチルスチレン、ρーメチルスチレン のようなアルキル置換スチレン、クロルスチレンのよう なハロゲン置換スチレンなど、従来耐衝撃性ポリスチレ ン系樹脂製造用として知られているスチレン系モノマー の1種又は2種以上の混合物が用いられる。これらのな かで好ましいのはスチレンである。ゴム状ポリマーとし ロセン型錯体、及び(b)非配位性アニオンとカチオン とのイオン性化合物及び/又はアルミノキサンからなる 触媒系で得られるHC-HVBR構造を有するブタジエ ンゴム、スチレンーブタジエンゴム、イソプレンーブタ ジエンゴム、ニトリルーブタジエンゴムなどを挙げると とができる。好ましくはブタジエンゴムである。

【0040】との発明において上記のスチレン系モノマ ーとゴム状ポリマーとを主体とする原料溶液は完全混合 型反応器において重合されるが、完全混合型反応器とし ては、原料溶液が反応器において均一な混合状態を維持 30 グラフト率=〔 MEK/AC—insol.(g)- R(g)〕× するものであればよく、好ましいものとしてはヘリカル リボン、ダブルヘリカルリボン、アンカーなどの型の攪 拌翼が挙げられる。ヘリカルリボンタイプの攪拌翼には ドラフトチューブを取り付けて、反応器内の上下循環を 一層強化することが好ましい。

[0041]

【実施例】以下、参考例、実施例及び比較例を示して、 本発明について具体的に説明するが、この発明はこれら によって制約されるものではない。参考例、実施例及び 度、分子量及び分子量分布、ミクロ構造及びスチレン溶 液粘度、耐衝撃性ポリスチレン系樹脂のゴム状ポリマー 含有率、グラフト率、膨潤度、ゴム粒子径、アイゾット 及びデュポン衝撃強度、引張特性及び光沢は以下のよう にして測定した。

<u>ムーニー</u>粘度: JIS K6300に従い、ゴムのムー ニー粘度ML,,,(100℃)を測定した。

<u>分子量及び分子量分布:ポリスチレンを標準物質として</u> 用いたゲル透過クロマトグラフィー(GPC)の分子量 分布曲線から求めた検量線を用いて計算し、重量平均分 50 破壊エネルギーで示した。

子量Mw 及び数平均分子量Mn と、分子量分布の広がり

の大きさとしてMw /Mn を示した。 ミクロ構造:赤外吸収スペクトル分析法によって、Ha mpton法より求めたシス-1,4構造;740cm -1, ピニル構造;911cm⁻¹, トランス-1, 4構 造;967cm-1の分子吸光係数からミクロ構造を算出

ガラス転移温度(Tg):示差走査熱量計(DSC) を用いて、昇温速度10℃/分で-150~0℃までの 範囲を昇温してガラス転移温度を測定した。

スチレン溶液粘度:5gのゴム状ポリマーを95gのス チレンモノマーに溶解した時の25℃における溶液粘度 をセンチボイズ (cp) で示した。

ゴム状ポリマー含有率:熱分解ガスクロマトグラフィー 法で0.5gの耐衝撃性ポリスチレン系樹脂を590℃ で熱分解させて生成したガスを水素炎イオン化検出器に て分析して、ブタジエンとスチレンのピーク面積比を求 め、予め作成した検量線と比較して求めた。

グラフト率:1gの耐衝撃性ポリスチレン系樹脂をメチ ては、前記の(a)周期表第5族遷移金属化合物のメタ 20 ルエチルケトン/アセトン=1/1(重量比)の混合液 50ミリリットルに加えて1時間激しく震盪し、溶解・ 膨潤させる。次に遠心分離機にて不溶分を沈降させた 後、デカンテーションで上澄液を捨てる。このようにし て得られたメチルエチルケトン/アセトン不溶分を50 ℃で減圧乾燥して、デシケーター中で冷却後、秤量して メチルエチルケトン/アセトン不溶分(MEK/AC-insol. g) を求めて、ゴム状ポリマー含有率から算出したゴム 状ポリマー量(R.g)から、次式でグラフト率を算出し

100/R(g)

膨潤度:トルエン50ミリリットルに耐衝撃性ポリスチ レン系樹脂1gを1時間激しく震盪後、遠心分離して不 溶分を沈降させて、デカンテーションにて上澄液を捨て る。沈降したした部分の重量(膨潤した未乾燥重量)を 測定した後、100℃で真空乾燥しデシケーター中で冷 却後、秤量して、膨潤時/乾燥時の重量比で示した。

ゴム粒子径:耐衝撃性ポリスチレン系樹脂をジメチルフ ォルムアミドに溶解させ、樹脂中のマトリックスを形成 比較例において、得られたゴム状ポリマーのムーニー粘 40 するポリスチレン部分のみを溶解させ、その溶液の一部 を日科機製のコールターカウンター装置、TA-2型を 使って溶媒ジメチルフォルムアミドと分散剤チオシアン 酸アンモニウムからなる電解液に分散させて、得られた 体積平均粒子径をゴム粒子径とした。

> 引張特性: JIS K7113に従って降伏点強度、破 断点強度、伸びを測定した。

アイゾット衝撃強度: JIS K7110 (ノッチ付) に従って測定した。

チュポン衝撃強度:デュポン式落錘試験機による50%

<u>光沢</u>: JIS Z8742(入射角60°) に準拠して 光沢を測定した。

【0042】 (参考例1) 窒素置換した攪拌機付5リットルのオートクレーブに30w t%の1,3-ブタジエンを含有するトルエン溶液(1,3-ブタジエン:814g)3.5リットルを導入した。次いで水素ガスを導入して、表1の圧力だけ高くした。30℃で3分かけてトリエチルアルミニウム2.25m-mo1を、次いでトリチルテトラ(パーフルオロフェニル)ボレート0.066m-mo1,シクロペンタジエニルバナジウムトリクロライド0.044m-mo1連続して添加して40℃で30分間重合した。重合条件を表1に、得られたボリブタジエンの13C-NMRスペクトルからの測定結果から算出されるダイアッド連鎖の含有率、1,2構造*

* と 1, 4 構造の分布状態を表すパラメーターの β 値を表 2 に、重合結果を表 3 に示した。

【0043】〔参考例2〕触媒量及び水素ガスを表1の通りに変更した以外は参考例1と同様にして重合した。 得られた結果を表2及び表3にに示した。

4g)3.5リットルを導入した。次いで水素ガスを導入して、表1の圧力だけ高くした。30℃で3分かけて ーブを使用して1,3ーブタジエンを20w t %含有す トリエチルアルミニウム2.25 m-molを、次いで トリチルテトラ (パーフルオロフェニル) ボレート0.066 m-mol,シクロペンタジエニルバナジウムト 10 外は参考例1と同様にして重合した。得られた結果を表リクロライド0.044 m-mol連続して添加して4 2及び表3に示した。

[0045]

【表1】

	重合条件											
参考例			sCB(C.F.).	CpVC1:		Temp. Time						
1 2 3 4	3 0 2 0	2. 25 2. 25	0. 066 0. 053 0. 045 0. 033	0.030	0. 20	40 23						

[0046]

【表2】

1

¹³C-NMRによる		\$	3		*		例											
ミクロ構造と連鎖構造			1				2		3		4							
ミクロ構造 (%)																		
シスー1, 4	8	8.	ı		8	6.	8	1	3 7	٠.	6		į	3 6	6.	0		
トランスー1, 4		1.	8			2.	0		ı		9			2	2.	0		
1. 2	1	2.	0		l	i .	2	1	C	١.	5		:	1 2	2.	0		
ダイアッド連鎖(%)					-													
(シスー1, 4) (1, 2)	1	1.	0		1	0.	4		8	١.	8			1	١.	1		
(1. 2-) (シス-1, 4)	1	٥.	0			9,	В		8	ŧ,	ı			1 (Ò,	0		
(トランス-1, 4) (1, 2)		0				0			C)				(0			
(1, 2) (トランスー1, 4)		0.	9	ı		0.	8		(١.	8			(D.	8		
(シスー1, 4) (1, 4)	7	5.	2	:	7	6.	5		7 7	i.	9			7 :	5.	1		
(トランスー1, 4) (1, 4)		1.	9	ı		ι.	9		2	2.	0			;	2.	1		
(1. 2) (1. 2)		1.	0)		0.	8		1	١.	0				1.	0		
構造含有率(%)																_		_
P _{1, 2}	0.	1	2 0	!	0.	1	1	2	(١.	1	0	5	(0.	1	2	0
P 1. 4	0.	8	8 0	}	0.	8	8	8	().	8	9	5	(0.	2	1	9
P 3. 8-1. 4	0.	2	1 9	l	0.	2	0	8	(١.	1	9	7	1	0.	2	L	8
分布パラメーター																		
В	1.	0	4		1.	(5		1		0	5			١.	0	4	

[0047]

* *【表3】

	重合結果											
参考例	Conv. ミクロ社			造 %		P	С	St-cp	ML1+	Tg		
	96	Cis	Trans	Vinyl	Mwx10-1	Mox10-6	Mbre/Nan	C. P		° C		
1	52.6	88. 8	1.6	9. 6	3. 58	1.08	3. 32	52	13	-100. 4		
2	46.7	88. 8	1.6	9. 5	4. 10	1.32	3. 10	78	20	-100.5		
3	48.5	89. 0	1.8	9. 2	2. 90	1. 3 3	2.18	33	10	-100.7		
4	28.6	88. 7	1.6	9. 6	4. 76	1. 97	2. 42	153	37	-100. 4		
5.		95. 8	1.8	2. 4	4. 31	1. 25	3. 5	41	29	-107.1		
6.	Ì	96. 9	1.3	1.8	4.84	1.34	3.6	62	39	-107.4		
7 °		33. 9	55. 4	10.7	3. 63	1.66	22	84	34	-93. 4		
8 4	İ	35. 2	55.7	9. 1	4. 56	1.88	2.4	166	52	-9 3.8		

a: 高シスBR b: 高シスBR c: 低シスBR d: 低シスBR

【0048】 [実施例 $1\sim4$] 撹拌機付1.5リットル g と表1 に示す参考例 $1\sim4$ で製造したHC-HVBR のオートクレーブを窒素ガスで置換し、スチレン465 50 の各35g(ゴム7重量部)を加えて溶解した。次いで

n-ドデシルメルカプタン0.15gを加えて、135 ℃で表3に示した条件で撹拌しながらスチレンの転化率 が30%になるまで1時間半予備重合した。次に、この 予備重合液に0.5 w t %ポリビニルアルコール水溶液 500ミリリットルを注入し、ベンゾイルパーオキサイ ド1. 0g (0.2重量部) 及びジクミルパーオキサイ ド1.0g(0.2重量部)を加えて100℃で2時 間、125℃で3時間、140℃で2時間攪拌下に連続 的に重合した。室温に冷却して重合反応混合物からビー ズ状のポリマーをろ過し、水洗・乾燥した。これを押出 10 【0050】 機でペレット化して耐衝撃性スチレン系樹脂450gを*

21

* 得た。得られた耐衝撃性スチレン系樹脂をそれぞれ射出 成形して物性測定用試験片を作成して表4に示す物性を 測定した。それらの結果を表4に示した。

【0049】 [比較例1~4]表2に示した参考例5~ 8を使用して、予備重合時の攪拌速度を変更した以外 は、実施例1~4と同様に重合して耐衝撃性ポリスチレ ン系樹脂を製造した。これを射出成形して物性測定用試 験片を作成し、目的の物性を測定して、それらの結果を 表4に示した。

【表4】

	予備重合	1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3											
	搅拌	٦ لـ	グラフ	膨	izod衝擊	Dupont	习伝	民族度	,	化沢			
	速度	粒子径	本	潤	強 度	衝撃度	降伏点	破断点	伸び				
	rpo	μm	96	度	Kg cm/cm	Kg cm	MPa	MPa	%	%			
実1	500	1.86	238	11.4	9. 8	39. 2	32. 6	31.7	38	76			
施2	500	2.34	262	10.9	8. 9	38. 1	30. 4	30.5	36	63			
61 13	500	1.30	226	12.1	10. 1	39. 6	34.0	31.2	54	80			
4	500	2.97	271	10. 4	8. 1	37. 8	31.6	31.0	29	58			
比1	550	1.85	218	10.8	10. 2	37. 4 [°]	32. 2	31. 4	32	69			
較2	550	2.35	228	10.8	9. 4	36. 5	31.4	31.0	27	62			
例3	500	2. 36	274	9. 7	8. 1	39. 6	31.6	30. 9	25	59			
4	600	3.01	280	10.0	7.3	37.7	31. 1	30.8	19	54			

比較例1~4は表2の参考例5~8に相当する

[0051]

【発明の効果】との発明におけるHC-HVBRは、シ ス-1,4構造が65~95%、ビニル構造30~4% で構成された高シスー高ビニルポリブタジエンであるた め、高ビニル構造に起因するスチレンモノマーとの反応 性は低シスBRと同等であり、このHC-HVBRを用※ ※いて得られる耐衝撃性ポリスチレン系樹脂は、光沢性と 面衝撃性が優れると共に高シス-1,4構造含有率に由 来するガラス転移温度の低さからアイゾット耐衝撃性、 低温特性も優れるという従来の高シスBRと低シスBR の特性を併せ持つゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂 である。

フロントページの続き

(72)発明者 鈴木 通典

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興 産株式会社高分子研究所内